静電浮遊炉を用いた高温液体の構造解析

正木匡彦、石川毅彦、依田真一

宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究本部 宇宙環境利用科学研究系

Liquid Structure Analysis of High Temperature Melts with the use of Electrostatic Levitation Furnace

Tadahiko Masaki, Takehiko Ishikawa and Shinichi Yoda Japan Aerospace Exploration Agency E-Mail: masaki.tadahiko@jaxa.jp

Abstract: The liquid structures of high temperature melts are essential information for the understanding of the thermo-physical properties in liquid state. The electrostatic levitation furnace, ESL, for the liquid structure analysis was developed for the observation of extremely high temperature melts or undercooled melts. The liquid structure of refractive metals and semiconducting materials can be successfully measured with the use of ESL coupled with synchrotron radiation facility.

Key words; Electrostatic levitation furnace, liquid structure

1. 緒言

金属や半導体の液体の構造と物性の理解は、凝集 体物理の興味ある研究課題であるだけでなく、凝固 過程や結晶成長プロセスにおける固液界面近傍の 液相側の原子配置などの重要な情報を与えうる。ま た、過冷却液体の物性の把握は,ガラスやアモルフ ァス材料など新たな材料の創生において不可欠で あり,詳細な研究が待たれている領域である。近年, 無容器実験法をもちいた過冷却液体状態の研究が 盛んに進められており,静電場法,電磁誘導法やガ スジェット法などの手法を用いた過冷却液体の物 性・構造研究や凝固過程の研究が進められている [1-5]。その中でも,静電場を用いた液滴浮遊法は, 金属・非金属を問わずに浮遊できる点だけでなく, サンプルサイズ (直径1~2mm)や雰囲気(高真 空もしくは高圧) などの実験条件が高温液体の物性 計測や構造解析に適した方法である[6]。この静電浮 遊法とX線散乱法や中性子散乱法を用いた構造解 析を組み合わせることにより,従来測定が極めて困 難であった高融点金属液体や過冷却液体状態の構 造解析を可能にするだけでなく,吸収や多重散乱の 補正を容易にし,測定の精度を著しく向上させるこ とが可能である。

高精度の液体構造の実験値から液体状態の微視 的な特徴を知ることができる。特に,過冷却液体に 存在すると期待される多面体クラスターや揺らぎ 構造は,散乱実験から直接的に得られる静的構造因 子や動径分布関数を調べることにより確認するこ とができると考えられる。また,精密に測定された 液体構造から,原子間ポテンシャルを決めることが 可能である.実験的に決めた原子間ポテンシャルか らは,拡散係数や粘性係数などの巨視的な輸送物性 だけでなく,液体内の構造の緩和過程の研究や実験 では実現不可能な急冷過程をへたガラス状態の可 能性などを探索することが可能となる。

JAXAではこれまで,宇宙空間の微小重力環境 における浮遊試料の位置制御法として静電浮遊法 を開発してきた[7]。良く知られているように,微小 重力環境において浮遊させた液滴を用いることに より,極めて高精度の液体物性を測定することが可 能である。本研究は,その宇宙実験技術を地上の研 究へスピンオフしたものであるが,宇宙環境利用と 独立したものではなく,宇宙実験による高精度融液 物性データを微視的な立場から理解し補完するこ とを目的としている。

我々は,過冷却液体状態とくに金属や半導体の過 冷却状態の微視的構造を詳細に調べることを目的 として,過冷却液体状態を安定して保持できる静電 浮遊法とX線散乱法を組み合わせることにより高 精度の液体構造解析装置を製作した。以下に装置お よび実験の概要を紹介する。

2.静電浮遊法の概要

静電場を用いる場合,試料を帯電させることによ り金属・非金属を問わず浮遊させることが可能であ る。本研究では上下に配置した電極の上側に - 10 ~ - 30kVの電圧を印加し,また正電荷を帯電さ せた試料を電極間に挿入し,重力と拮抗した上向き の力を発生させた。このような電極と試料の配置で は,パッシブな安定点が存在しないことから,試料 を電極の中間に保持するためには試料位置の計測と 電極間電圧の制御を高速に行う必要がある.本装置 では,ポジションディテクタからの信号を元に高速 直流アンプをコンピュータ制御し,約720Hzの 制御サイクルにより安定した浮遊状態を実現した。 電極間に高電圧をかけることから,電極と試料は 10⁻⁴ Pa程度の真空を維持できる高真空チャンバー 内に配置した。高真空雰囲気は,溶融させた試料の 酸化を防ぐとともに,試料の帯電状態の維持に寄与 している。真空中に浮遊させた試料の加熱には,炭 酸ガスレーザーを使用した。試料温度については単 色の放射温度計を使用して測定した。真空チャンバ ーの側面には,X線の入射用および散乱強度を検出 するための窓(2 = -10~+80°)を配置し た。

3.静電浮遊装置と放射光を用いた X 線散乱実験

X線散乱実験用の真空チャンバーは,SPring-8の BL04B2ビームラインのランダム系ステーショ ンに設置できるように製作した。なお、この装置は 実験室のX線回折装置(Rigaku SWXD)にもその まま設置できるように設計しており、実験室におけ る事前の試行的実験を効率よく行える設計とした。 これまでに,IVB族液体(シリコン,錫,鉛)、 高融点金属(ジルコニウム,ハフニウム,ニオブ)、 準結晶形成合金(AIPdMn)および半導体融液(BaGe) の浮遊液滴試料を用いたX線散乱を行い、液体構造 の取得に成功した。X線散乱には113keVの高エ ネルギーの単色X線を使用し,二軸回折計,スリッ ト光学系および半導体検出器を用いて透過法による 散乱X線の強度の角度分布を測定した。

静電浮遊法を用いて試料を浮遊溶融させる場合, 試料の帯電量を維持することが極めて重要である. 比較的高融点の物質の場合,浮遊前にあらかじめ試 料を加熱し,熱電子放出によって帯電量を増加させ ながら浮遊させることが可能である。本実験におい ても,高融点金属やシリコンについては、浮遊させ る前に試料を1400K程度に加熱し,安定した浮 遊溶融状態を実現した。融点の低い錫などの物質に ついては、固体の状態で浮遊させた後にX線の光電 効果による帯電量の増加をみながら徐々に加熱する ことで浮遊溶融状態を実現した。

試料の温度制御については,炭酸ガスレーザーの 出力を制御することにより行った。特に,試料を過 冷却液体状態にする際には,試料を融点よりも100K 程度高温に加熱して資料を十分に溶融させ,続いて 炭酸ガスレーザーの出力を徐々に下げながら融点以 下に冷却した。なお,放射温度計の指示値を常にモ ニターし,凝固に伴う急激な温度変化やリカレッセ ンスなどの無いことを確かめることで,過冷却液体 状態であることを確認した。試料の浮遊溶融状態を 確認した後にX線検出器のビームストッパを開放し, 散乱強度の角度依存性を測定した。

4 X線散乱実験の結果と解析

実験結果の一例として融点及び過冷却液体状態 のジルコニウムのX線散乱強度の角度依存性およ び真空チャンバーのみからの散乱(バックグラウン ド)を図1に示す.高真空のチャンバーを用いるこ とにより,バックグラウンドの強度をほぼゼロにす ることができた。なお,無容器の浮遊状態であるこ とから,試料のみからの散乱を計測できるため,そ の後のデータ解析を容易かつ高精度に行うことが できた。



Fig,1 Scattering intensity of x-ray diffraction of liquid zirconium.

散乱×線強度を規格化し,静的構造因子S(Q) や動径分布関数g(r)を求める際に,一般的に吸 収補正,偏光補正や多重散乱補正などをする必要が ある.

$$I^{obs}(Q) = PA\left[I^{coh}(Q) + I^{inc}(Q) + I^{mul}(Q)\right]$$

ここで, I^{OBS} は実験で得られた散乱強度, I^{coh} は弾 性散乱強度, I^{inc} は非弾性散乱強度, I^{nul} は試料内で 2回以上散乱した多重散乱の強度である.Qは波数 であり, 散乱角2 とは以下の関係がある.

 $Q = 4\pi \sin \theta / \lambda$

特に,吸収補正と多重散乱補正については,試料 形状や吸収係数に大きく依存するため,これまで実 験後のデータ解析を困難にしてきた。浮遊液滴を用 いた場合,ほぼ真球状の試料形状であるために,こ れらの補正を比較的容易に,かつ,高精度に行うこ とが可能である。X線に完浴させた球状試料の吸収 補正に関しては以下の式を用いて計算された数値 がデータベース化されて公表されている[9]。

 $A = \frac{1}{V} \int_{v} \exp(-\mu l) dv$

ここで1は微小体積 d v で散乱された X 線に関 する試料中の光路長であり,µは試料の吸収係数で ある.本実験の場合,入射 X 線の幅(0.7mm) が試料の直径(2mm)よりも小さいため,データ ベースの値をそのまま用いることができない。その ため公表されているデータと同様の方法を用いて 吸収が大きな場合の吸収係数を新たに計算した。 多重散乱については,微小な球状試料を用たことか ら無視できる程度に小さいとした。以上のことを考 慮して、測定した散乱強度からそれぞれの液体の性 的構造因子S(Q)を求めた.結果の一例としてジ ルコニウムの静的構造因子を図2に示す。



Fig.2 Static structure factors of liquid zirconium

5.液体構造に基づく有効原子間ポテンシャルの導出

液体論における逆問題の方法を用いることで,静 的構造因子から原子間の二体ポテンシャルを求め ることができる[10]. Modified Hypernetted Chain (MHNC)近似から,原子間の有効二体ポテンシャル u(r)を以下のように書くことができる.

$$u(r)/k_B T = g_{exp}(r) - 1 - c_{exp}(r) - \ln g_{exp}(r) + B(r)$$

ここで,g_{exp}(r)は実験で求めた動径分布関数,c_{exp}(r) は直接相関関数である。

逆問題の方法とは, MHNC近似により求めた原 子間ポテンシャルを再帰的に分子動力学計算に用 いることで,実験のS(Q)を再現するようなu(r) およびブリッジ関数,B(r)を決める方法である. この逆問題の方法を用いる際に,大規模分子動力学 計算を行うことで原子間ポテンシャルを高精度に 決めることができることが知られている[11].今回 の計算では,約6万個から10万個の原子からなる ユニットセルを用いた分子動力学計算を行い,u (r)を求めた.融点のジルコニウムのS(Q)に 対して,得られた原子間ポテンシャルと動径分布関 数を図3に示す.



Fig.3 Effective pair potential and radial distribution function of liquid zirconium at melting temperature

有効二体原子間ポテンシャルから,液体の静的お よび動的物性を計算することが可能である.たとえ ば,自己拡散係数Dのような原子輸送物性は,分子 動力学計算から以下のように求めることができる.

$$D = \frac{1}{3} \int_{0}^{\infty} \langle v(t) \cdot v(0) \rangle dt$$

ここで, vは各粒子の速度である。現在,測定した 液体構造を元にこれらの解析を進めている。

6. 結言

静電浮遊法およびX線構造解析法を用いて,高温 金属液体および過冷却液体状態の液体構造の解析 を試みた。この手法を用いることで,超高温融体や 極めて深い過冷却液体状態の構造の研究や輸送物 性の理論計算を進めることが可能である。本研究が, 将来の微小重力環境を利用した過冷却液体の熱物 性研究の相補的な役割を担い、熱物性研究の進歩に 寄与することを期待する。

参考文献

[1] T.Ishikawa, P.-F Paradis; T.Itami and S. Yoda, Meas.

Sci. Technol. 16(2005), 443-451.

- [2] K. Higuchi et al. Meas. Sci. Technol. 16(2005), 381-385.
- [3] S. Krishnan and D. Price, J. Phys: Cond. Matter, 12(2000), R145-R176.
- [4] K. Kelton, G.W. Lee, A. K. Gangopadhyay, R. W. Hyers, T. J. Rathz, J. R. Rogers, M. B. Robinson and D. S. Robinson, Phys. Rev. Lett., 90(2003), 195504.
- [5] D. Holland-Moritz, D. M. Herlach and K. Urban, Phys. Rev. Lett., 71(1993), 1196.
- [6] W.-K. Rhim, S. K. Chang, D. Barber, K. F. Man and G. Gutt, Rev. Sci. Instrum., 64(1993), 2961.
- [7] T. Ishikawa, P.-F. Paradis, and S. Yoda, J. Japan Microgravity Appl., 18(2001), 106.
- [9] A.J.C. Wilson and E. Price (ed.), "International Table for Crystallography", vol.C(1999), 594-596.
- [10] L. Reatto, D. Levesque and J. J. Weis, Phys. Rev. A, 33(1986), 3451.
- [11] S. Munejiri, F. Shimojo, K. Hoshino and M. Watabe, J. Phys. Soc. Japan, 64(1995), 344.